

令和5年8月1日時点

供用の対象とする施設・設備等一覧

○ 那珂研究所

<u>施設名</u>	<u>供用の対象設備</u>
超伝導機器試験施設	CSモデルコイル試験装置
プラズマ対向機器試験施設	JEBIS、高温 He リーク試験装置
高周波加熱装置試験施設	長パルスジャイロトロン試験装置
中性粒子入射加熱装置試験施設	MeV 級イオン源試験装置、大電流イオン源試験装置 (DATS)

○ 六ヶ所研究所

<u>施設名</u>	<u>供用の対象設備</u>
原型炉 R&D 棟	微細構造解析装置群（二次電子顕微鏡、透過型電子顕微鏡、電子プローブマイクロアナライザー、集束イオンビーム加工装置）、多目的 RI 実験室、Be 製造設備室
ブランケット工学試験棟	ブランケット安全実証試験装置群（大面積熱負荷試験装置、噴出漏洩試験装置、高温高圧水腐食試験ループ、ベリリウム-水蒸気反応試験装置）
共同研究棟	疲労試験機、クリープ試験機、Be 製造室
計算機・遠隔実験棟	スパコン (JFRS-1)、遠隔実験室

以上